

温暖化防止への取り組み

地球の温暖化は進行しています。カシオが今取り組めることは、今実践します。CO₂排出量削減は、地球の環境収容能力の持続を実現するための使命と考えます。

生産事業所におけるCO₂削減

国内の取り組み

カシオは、2010年度を目標とした省エネに取り組んでいます。2006年度の国内の生産事業所のCO₂排出量実績は、デバイス系事業所が約8割を占め、カシオマイクロニクスの山梨工場拡充や、対象拠点の追加（セイヨー電子等）があったものの、山形カシオの省エネ設備への切り替えや他拠点の努力で、全体では396トンのCO₂の削減となりました。原単位は横ばいです。2010年度の原単位目標との差は大きく、今後は、拠点ごとの新規設定目標値に向けた追加施策の共有化と継続検討を行い、過不足分の見極めをした上で、排出権取引等の検討もしていきます。

CO₂排出量と実質生産高原単位の推移（国内）



海外の取り組み

2006年度の海外の事業所のCO₂排出量実績は、生産系事業所が約78%を占め、前年度比で約2.3千トン-CO₂の増加となりました。これは、中国で、手狭になったカシオ電子中山とカシオ電子珠海を新工場のカシオ電子科技中山に統廃合し、生産を拡大したことが主な理由です。海外の生産高合計が増えたことによって、生産高原単位で見ると目標の0.31をクリアしました。今後は拠点ごとの目標設定を見直し、更に省エネを推進していきます。

CO₂排出量と生産高原単位の推移（海外）



温室効果ガス(SF₆)削減の取り組み

SF₆ガスは、高知カシオにおいて、TFTパネル製造のドライエッチング工程で使われています。年間購入量は2ト弱ですが、温暖化係数が23,900と非常に大きいため、カシオ計算機のデバイス事業で排出する、CO₂を含めた温暖化ガスの約20%を占めています。

SF₆ガスの排出量削減は、カシオ計算機全体から見ても非常に重要なテーマの一つであり、八王子技術センターでTFT製造工程からの排出量削減の技術検討に取り組んでいます。排出量の削減の手法としては、

- ①温暖化係数の小さい代替ガスによるドライエッチングプロセスの開発
 - ②SF₆の除害設備の導入
 - ③SF₆のリサイクル
- の3つの方式が考えられます。

代替ガスプロセスの検討は2004年から着手しており、使用するガスの絞り込みが完了しています。SF₆除害設備およびSF₆リサイクル設備の導入についても検討を始めています。

2007年末までに代替ガスプロセスの開発および、排出量削減のための設備の調査を完了させる予定です。効果性、コストパフォーマンスなどを総合的に判断して、どの手法でSF₆の排出量を削減するのかを決定し、2010年には、公表目標を達成する計画です。

資料 SF₆ガスの使用量・排出量とCO₂換算排出量の推移

SF₆ガスの削減対策とスケジュール

削減対策	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
代替ガス	試作レベル評価	製品レベル評価			
SF ₆ 除害			方式決定 ・削減効果 ・プロセス適合性 ・ランニングコスト	設備発注 設置	2000年 排出量以下 達成 <7,278 トン-CO ₂ /年
SF ₆ リサイクル	設備調査				

※SF₆ガスはJEITA（社団法人 電子情報技術産業協会）の自主行動指針にて削減対象に定めた温室効果ガスの1つです。この対象ガスのうち、カシオは、SF₆を除く、PFCs、NF₃を既に全廃済みです。